

簡稱	XPS
中文名稱	X射線光電子能譜儀
英文名稱	X-ray photoelectron spectroscopy
圖片	
功能說明	<p>物質表面的定性及定量化學分析</p> <p>量測Valance band 和功函數</p> <p>量測電子親和力</p> <p>XPS特點(下載)</p>
儀器服務項目	<ol style="list-style-type: none"> 1.全能譜圖(survey) 2.單元素能譜圖(multiplex) 3.元素線掃描(line scan) 4.元素影像掃描(mapping) 5.成分縱深分析(depth profiling) 6.紫外光電子能譜(UPS) 7.低能量反轉電子能譜(LEIPS)
儀器購置日期	2020/10/20
儀器廠牌	ULVAC-PHI. Inc.
型號	PHI 5000 VersaProbe III
儀器規格	<ul style="list-style-type: none"> ·X-ray光源：Al Kα Monochromator ·真空系統$\leq 6.7 \times 10^{-8}$ Pa ·能量解析度$\leq 0.5\text{eV}$ at Ag 3d$^{5/2}$ peak ·分析面積$\leq 10\mu\text{m} \sim 1400\mu\text{m}$ ·UPS：Ultra Violet source (He紫外光光源)
主要配件·校正器	UPS、LEIPS
樣品準備	薄膜、塊材、粉末(須壓錠)
注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1.樣品不得具有磁性、揮發性、毒性、輻射性。 2.樣品尺寸：面積小於5*5mm,厚5mm。 3.粉體樣品須事先壓錠。 *若粉體樣品未壓錠好，將不予以測量；或是測試期間，因樣品損壞儀器，均由申請人負擔賠償責任。 4.樣品須自行前處理(烘乾、除水)，以便實驗過程中真空度降至1×10^{-7}。 5.進行微區分析時，申請人須親自到場指定受測區。 6.樣品預約時請先下載X射線光電子能譜儀(XPS)服務辦法和樣品預約單。
儀器放置位置	工程三館 ES104